

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成19年2月15日(2007.2.15)

【公表番号】特表2002-533216(P2002-533216A)

【公表日】平成14年10月8日(2002.10.8)

【出願番号】特願2000-590845(P2000-590845)

【国際特許分類】

B 01 D	71/02	(2006.01)
B 01 D	53/22	(2006.01)
B 01 D	69/10	(2006.01)
B 01 J	20/28	(2006.01)
B 01 J	20/30	(2006.01)
C 01 B	39/02	(2006.01)
C 01 B	39/22	(2006.01)
C 01 B	39/24	(2006.01)
C 01 B	39/36	(2006.01)
C 01 B	39/38	(2006.01)
C 01 B	39/52	(2006.01)
C 04 B	41/85	(2006.01)
B 01 J	20/18	(2006.01)

【F I】

B 01 D	71/02	5 0 0
B 01 D	71/02	
B 01 D	53/22	
B 01 D	69/10	
B 01 J	20/28	A
B 01 J	20/30	
C 01 B	39/02	
C 01 B	39/22	
C 01 B	39/24	
C 01 B	39/36	
C 01 B	39/38	
C 01 B	39/52	
C 04 B	41/85	C
B 01 J	20/18	E

【手続補正書】

【提出日】平成18年12月22日(2006.12.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項25

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項25】触媒が、前記基体を構成する組成物とモジュールを形成するまたは該組成物内に含まれることを特徴とする請求項22記載の方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項29

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 9】 前記基体を構成する組成物が前記供給原料の少なくとも 1 つの分子種を吸着することを特徴とする請求項 2 2 記載の方法。